



同轴热电偶瞬态热流传感器等离子喷涂式绝缘层加工制作装置

韩桂来¹; 姜宗林¹

2021-10-19

专利权人 中国科学院力学研究所

摘要 本发明公开了同轴热电偶瞬态热流传感器等离子喷涂式绝缘层加工制作装置, 包括用于传感器喷涂的喷涂腔室, 所述喷涂腔室的一端设置有传入口, 所述喷涂腔室的另一端设置有牵引出口, 所述喷涂腔室内靠近所述传入口缠绕设置有用所述传感器加热的涡流线圈, 所述喷涂腔室靠近所述传入口的一侧设置有用所述传感器表面抛光的抛光组件, 在所述传入口和所述牵引出口之间的所述喷涂腔室内设置有用所述传感器绝缘层喷涂的喷涂组件。本发明通过设置在喷涂腔室内的抛光组件在传感器喷涂前进行抛光处理, 以减少传感器表面的杂质, 提高等离子绝缘层与传感器表面的吸附效果。

申请日期 2020-12-04

授权日期 2021-10-19

专利号 ZL202011408127.9

语种 中文

授权国家 中国

代理机构 北京和信华成知识产权代理事务所

文献类型 **专利**条目标识符 <http://dspace.imech.ac.cn/handle/311007/88109>

专题 高温气体动力学国家重点实验室

作者单位 中国科学院力学研究所

推荐引用方式 韩桂来, 姜宗林. 同轴热电偶瞬态热流传感器等离子喷涂式绝缘层加工制作装置. ZL202011408127.9[P]. 2021-10-19. GB/T 7714

条目包含的文件

[下载所有文件](#)

文件名称/大小	文献类型	版本类型	开放类型	使用许可	
20211019_OC_CN_0 (1) (432KB)	专利		开放获取	CC BY-NC-SA	浏览 下载

文件名: 20211019_OC_CN_0 (1).pdf

格式: Adobe PDF

此文件暂不支持浏览

所有评论 (0)

[\[发表评论/异议/意见\]](#)

暂无评论

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

个性服务

推荐该条目

★ 保存到收藏夹

📊 查看访问统计

📄 导出为Endnote文件

Lanfanshu学术

📖 Lanfanshu学术中相似的文章

📖 [韩桂来]的文章

📖 [姜宗林]的文章

百度学术

📖 百度学术中相似的文章

📖 [韩桂来]的文章

📖 [姜宗林]的文章

必应学术

📖 必应学术中相似的文章

📖 [韩桂来]的文章

📖 [姜宗林]的文章

相关权益政策

暂无数据

收藏/分享

